Институт сильноточной электроники СО РАН Наиболее значимые результаты научных исследований, полученные в 2020 году

Многоканальная диффузная плазма, как устойчивая форма горения разряда при высоких удельных мощностях накачки

Предложена и реализована новая форма горения диффузного разряда в плотных газовых смесях с электроотрицательными компонентами, состоящая из самоорганизующейся структуры множественных диффузных каналов. Применение разряда В плотных газовых средах, включающих расширить электроотрицательные добавки (галогены, кислород) позволило диапазон устойчивого существования диффузной плазмы с концентрацией электронов до 8×10^{15} см⁻³ при сохранении свойств активной среды в течение всей длительности импульса накачки. Формирование множественных равновесных диффузных каналов обеспечивалась за счет скорости роста плотности тока более $6 imes 10^{10} \; \text{A/(cm}^2 imes c)$ и приведенной напряженности поля в момент пробоя разрядного промежутка не менее 3 кВ/см×атм. Выбор соотношения донора и акцептора электронов в составе газовой смеси позволяет реализовывать завершенную или незавершенную стадию развития множественных диффузных каналов в разряде.

Практическая реализация данной формы разряда в электроразрядных KrF и XeCl лазерах позволила при удельной мощности накачки более 5 MBт/см 3 достичь рекордных значений удельной энергии излучения (более 10 Дж/л), при КПД лазеров ~ 2 %. Также впервые получена активная среда на трехатомной молекуле Kr₂F в разрядной плазме, которая позволяет усиливать импульсы излучения фемтосекундной длительности в видимом диапазоне спектра в течение 300 нс.

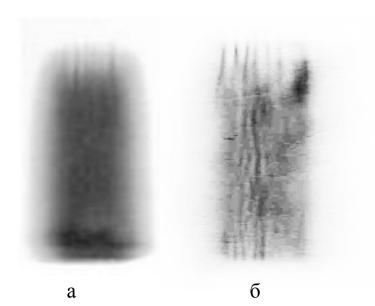


Рис. 1. Фотография разряда в незавершенной (а) и завершенной (б) стадиях формирования множественных диффузных каналов в плазме XeCl лазера при удельной мощности накачки 5 MBt/cm³.

Публикация:

1. S. A. Yampolskaya, A. G. Yastremskii, Y. N. Panchenko, A. V. Puchikin and S. M. Bobrovnikov. Numerical Study of the Discharge Spatial Characteristics Influence on the KrF Laser Generation // IEEE Journal of Quantum Electronics. 2020. Vol. 56, No. 2. P. 1-9.